

便 光 精 美 役 *1次的超回 出域年月日 - 出版3号 7×9分合級図 1975年 3月19日 第559978号

神 紫 蔵

昭和 51 年 3 月 19 日

(4 00 n.j·)) (2000)***

特許庁長官 片 山 石 郎 殿

1. 発明の名称

た を は 位

2 発明 春 住所 アノリカロ地田 ペンシルベニア州 ランカスタ スプリング・パレイ・ロード 2978

氏 お アルパート マフクスタエル モレル

3. 特許出版人 住所

アメリカ合衆国 ニユーヨーり州 10020 ニユーヨーク ロツクフエラー フラザ 30

名 株(757) ナールシーエー コーポレーション 代表告 エル・エス・サイナーエー ション

田 領 アメリカ合衆国 リー

4. 代理人 任丽

郵便器号 651 神戸市荘会は召井及7丁目4 34 神戸新聞会館内 पは (078) 251-2211 (5376) 物 水 哲: (ほか2名)

が表

rel Hil de

. 発明の名称

氏 名

磁镀镍镍

2. . 特新前水の範囲

スクリンを極度する変光体素子と関子ビームの 衝撃点とを用わらわすために行孔シャドクマスク を振いる形式であつて:

上記マスクの繰りもつた2つの孔の中心削減か 一様でなく、さらに

上記マスクとスクリンとの所がら出が、上記時 りあつた孔の中心関係の変化には消して変化する ようにされていることを特慮とする必須破費。

3. 発明の詳細を説明

この無明は、な礼シャドクマスクを内はする別の臨城県慣に、特に、 宮のタオームアップ貼に、シャドクマスクが埋化状に廃土る現象(以下ドーミングとする) によつて少じる宮のスクリンの姿と体みでとれでピームとの恵なり 佐岡の不敷み(以下は吹けれという) を取少し得るシャドクマスクの機収に関するものである。

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特関略 51-118956

❸公開日 昭51. (1976)10.19

②特願昭 5/- 30758

②出願日 昭少 (1978) 3.19

審査請求

(全7頁)

庁内整理番号

7525 59

130日本分類

(1) Int. Cl2

99 F120.2

HOIJ 29/07

カラー映像を発生するためのシャドウマスク型 能域保管では、多数の礼を持つ色遊択シャドクマ スクを加して、選取の無果された哲子ピームか、 モザイク状の変化スクリンへ投射される。それら のビームの進路は、マスクを通って、名しつのビ

のビームの港路は、マスクを誘つて、各1 つのビームが、それぞれスクリン上の発色磁光体の1 被組だけに突き出たり、これを衝撃して励起させるように定められている。一般に、シャドクマスクは、独固な枠に取付けられ、この枠付映像管の外出器の中に支持されている。

カラーなが電線管の動作時で、シャドクマスクは、電子面配で、シャドウマスクの間には少々 五重量のある時にとりつけられ、この神がドーキシック(郵受入場)として強くから、マスクの中心の引力と問題が分との間にはある温度差が発力といる。この問題が分との関系で形成する。こののののでは、マスクの中央部分では、マスクとスクリンとの問の限

[A]

MKR发化があつたとしても、発光体がでなのピー ムの低級的な趣行のは影響がないから、このドー モングは、スクリン中央部での電子ピームと発光 体策でとの位置の負力りにほとんど影響を及ぼさ ない。また、マスクの耐辺都分では、砂に個鬼さ れているので、この部分とはポーミングが生じな い。そくで、ドーミングによる反大の位配すれば、 マスクの中心と、マスクのವほどのだいたい中央 付近代現われること代かる。ととて「位間すれく mieregietar)」は、電子ビームが、それに対応す る盤光体発子から偏心する舞と双鏡する。上述の ドーミングが現われるために、マスクを泊り抜けた 電子ピームは、スクリンの整光体発子との側に位 関ずれを生じる。とのドーミングによる位置すれ は、筒が動作を始めてから、るから5分でピーク に遊するか、そらに10から15分削は、成長しなが ちも、特の性能に影響を与える。皆が安定した温 度状態化造すると、マスクの影威によつて並じた 電子ピームの位置すれば、全体として、マスクと フレーム組立をスクリンに同けて移動させる后度

のネツク部24とから収る排気されたガクス外物器 20を餡んている。パネル22は、フェースブレート 28と、これを狙むフランジまたは創坐50を有し、 この倒壁30によつてファンホル図26に対迎されて いる。フェースプレート28の内向にな、モザイク 伏の3位の最近体から波るスクリン32が設けられ 、ている。このスクリン32は、硝スクリンナなわち、 管のスクリンの後戌朔に事実上平行な極光体協力 5 成る平行競光体根辞もるいは終から成る配列を 持つものである。確接する登光体線と鉄片体線の 盾は、 光吸収性効質で想められている。 とのスク リン32と所足の関陥関係をもつて、多数の孔があ けられた巴君沢南城をすなわちシャドクマスク24 が、収外し可能に取付けられている。ネック24の 中化はインライン型電子銃35が数けられている。 煮不統3.5は、第1図の仮説で示されているように、 5 本の母イビーム38B、35R および5B 0 を発生し、 とれらの引イビームが、 投通平面にある無中面路 凡前つて、マスク34を辿り抜け、スクリン32まで 好かれる。ヨーク40亿朝団な軍比が与えられると、

特限期51-118956 (2) 密知性を持つ幹支持手段化よつて帰債される。と のような監管構備支持予段は、モレル(Morryst) 氏の米國特許第3.803,436岁代明示されている。

ドーミングにいくらかの関係のある期の問題として、大がくれ(blieter) 様のマスクの部分的な はりかめる。この「火がくれ」は、智の動作中に、 ビデオのパクンたとえばより映像中の特殊的な自 告スポットによつてマスクの一部に局部的な知動 が与えられることによつて生じるものである。

この発明の、有礼シャドウマスク型暗複複符は、マスク中の限りあつた孔の中心胸の水平石向間隔と、マスクかよびメクリン間の問題の及方が、マスクの中心から防縁を開かって、比側的に変化するマスクを備えている。この発明によつて、マスクのドーミングと「火がくれ」場象が低級され、これらの問題に起因する準でピームの位置すれる

第1図の、従来の氏刃形吹留田を持つカラー映像竹を示し、長月形パネルあるいはキャップ20と、 これに、ファンネル凱26を介して紹介された質状

これらる本で-4305、38R かより38 G は、 近前 1 かよび 水平の 数場 の影響を受けて、 スクリン52の 全面に付って、 最力形の ラスタを作るように、 水平と時間方面の走昼を行なう。

第1 図では、簡単化のために、 偏回 段成にかける 協向されたビームの個別の場页の曲線は示されて ない。 その代りに、 これらのビームが、 強肉値 ロ ・ Pで、 突然を行れ出っているように示されてい よ

とこでは、インライン製電子統を持つ収スクリン型の路板製管について、との色明の説明を進めるが、一般的に召つて、との発明の今え方は、デルタ配置の電子銃を持つよット産業体スクリン型等を保管あるいはその他の型の必須積をにも適用可能であるものと型脱されたい。

この発明を死分に照解するだめ、別子ピームの「仏殿でれ」とは何かを知ることが突ましい。第2時、第3時かよび第4回に、スクリン32の一部に突き当たる電子ピーム389が戻されている。各族大体線(42R、42g かよび42B)は、論むりも

のとなに勝てられ、その前原は光吸収性効質44で 想められている。ピーム380の邸は、その対応す る笠光状頃420の脳より、健か氏以くされている。 このような遊校は、一般は、良公差マトリックス と呼ばれ、との発用を実施するのに好ましいスク リン機器である。しかし、この発射は、正公差マ トリッグス替(尤்敬収性物質で隔てられている祭 光体線の繋が、対応するピーム塩より広いもの) および無マトリックス質化も同じよう代数取可能 てある。労る國で、寄子ピーム38日は、対応する。 登北体線420と、正確に中心が合つている。とれ が、正磁カカラー出力(発色)を得るために望せ れるピーム位置である。世のタオームアンブが始 まると、シャドクマスクのドーミングが現われて、 マスクの中心部分をスクリンド向けて移動させ、 男3宮KがたされるようK、ピーム380と盤光体領 42 G との位因すれが始まる。くの好でな、緑魚光 体線は充分な励起が得られなくなり、緑色出力の 鎖さが落ちる。第4図は、さら化極端な場介を永 し、ここでは、哲子ピー 4880 は、終の扱为体領

野町851--118956 (3) 42Bをただく範囲まで位置すれを生じており、色 純度に係る問題を起こす。

ドーミングは、マスクの内検部が関定保持されているとき、マスクの一部かスクリンに向つて移動する風象であることに任けているである。との移動の効果が第6回に強かれている。シャドクマスクは、加熱されず使つてドーミングを生じていない符号34で示される位因と、加熱されてドーミ

マスクのタオームアップの選行化件をつて、マスクのでの温度勾配が減少するので、ドーミング
効果も減少する。さらに、マスクの四級によつて
マスタが膨脱して拡かり、これによつて、マスク
の礼仏をが、元の位置から報方に、外回もにくす
なわち、スクリンに平行に)移動させられる。こ
のよりな外回きの形がによつて、スクリンの中心
から近ざかる同きの新たな位置ずれが生じる。そ
こで、このドーミングの減少とマスクの加熱の部
仕せによつて、マスクの礼が、対応する最先体限

と一致する何きに使ることになる。しかし、マス クの駆賊は、スクリンの砲辺器において、さらに きびしい位置ずれの問題を生しる。この、スクリ ンの固級形での位置すれを低正するために、マス ク・梅拉体を結ぶ勿支持体よに炎え、くのマスク ・枠機体をスクリンに向けて移動させ、マスクの 形盤による位置すれを除去し、あるいは少なくと も並少するととが一般の行なわれる。 この方法で 得られる補償は、支持你中のマスクの各能分の間 に温度勾配が存在しない場合ののみ正しいので、 中間の点では、第8回の曲線で示されるような、 いくらかの強留ざれが存在する。また、マスクは、 その問様すなわち体化、大きなヒートシンクを枠 つ形をしているから、管の動作中、マスクには信 化いくらかの熱の移動と最変変化が存在し、従つ て、いくらかのドーミングが常に存在する。

第7回にもるシャドクマスク色の各部の後何学 的関係が示されている。様₽- Pは、第1例と同 様に限同的(零偏向での)を表わす。平向 P - P とスクリン32との内の距離は [®] L [®]で、また、シ

[8]

[0]

(B)

ヤドクマスク36とスクリン32との周の間隔(軸報 A - A K 単行に助つて) は " q " で示されている。 さらに、印催"さ"は、中心前線A-Aから、あ る聯級から強れた電子ピームの中心54までの偏向 同P‐Pにおける距離を、また、 ° a ° は、マス 231の2つの孔の中心 - 中心関隔を表わすものと する。以上に述べたす法は、だいたい次の式で岩 示されるような関係を持つている。

との発明では、ドーミングの効果を減少する目 的で、シャドクマスク56に対して、従来の、同様 構造の皆で見られるより火きい由率を与えて"q ° **化より大きい変化を与えている。同時に、 ゚α゚** の値も『a゜状比例して変更される。このことは、 マスク全体に亙つて『a゜のほが一様とされ、 " q " が、 " 1, " かよび " 5 " だけの変化化件な つて登化できるようになつている、従来の根スク リン型階振線管とな品なつている。

第8圈、第8人图、第8日图私上び第8日图代

メク中心部の 0.77 mm から筒辺形の 1.14 mm まで 変化させられるなら、スリット軸は、所定の透過 「革を得るためには、マスク全体に亘つて一定四 Q.15 mm 化鉄つてもよい。スリット服の塔大は、 これによつてマスクの製作が容易になるので、人 いに鈺せしいことである。

2 つの従来の管と、 2 つの、この発明に従つて 製作された包について、マスクからスクリンまで の距離(1-宮の主軸線に平行に朝つた)の比が、 炎 A 化示されている。第1の列は、マスクの中心 部での9代対する、マスク層の長軸上での段立路 れかける9の比を示す。また、磐2列は、マスク 而の対角線上にかける同じ比を示す。

YD]

| <u>表 ^</u> | 長軸級Q | 対角線 q 中心 q |
|--------------------|--------|---------------|
| 19型 90度偏向從来管 | 1.13 | 1.12 |
| ·25型110度偏向 - 4- | 1.10 | 1.09 |
| 25 型管 16 1 C の発明の管 | 1.47 | . 1.45 |
| 25 型位 & 2 - // - | 1,58 | 1.48 |
| この発明の質では、潤さ | 2.数中心。 | 周隔比が、福 |

特別的51·118956 (4) 明 七半径 1000 mm の従来のシャドクマスクが収さ れている。このマスクの『゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙ れなど、スリット (鮭長の孔)の個は、 mm 単位で置わされている。 ブスクの中心が60、間辺郡62および中心と関切と つ中間の部分54にかける * a " の至は 定数 0.77 MPであることが示されている。スリット幅は、マ スク34の中心 8860から周辺 8862へ 向って、 次名化 寸法が短くなるように変化させられている。

第9回、第9点回、第9日即かよび第90回収 旅された。との発明の一笑脆例である虫率半銭 850 mm のシャドクマスク56では、孔(この場合ス リット]の中心関節館 * a * は中心部66で 0.77mm 中間点60で 0.885 mm、間辺路70で 1000 mm という 其合に次然に大きくなつている。第3四の従来の マスク34で用いられたものと同一のスリット幅が、 新9財のマスク56でも用いられるならば、マスク の通過器が所築レベルよりも承少されよう。従つ て、マスクの所以の透白客を維持するために、と のスリット値は従来のマスクのスリット組化比べ て大きくされている。実際に、『a゚の奴が、マ

米食での師じ比より可収り大きいととがわかる。 また、この希引の実施された数の2例について、 商辺対中心も開拓比のほはすべて 1,15より大きい くともわかる。

シャドクマスクの曲器を、 半径 1000 mm から半 径 850 mm まで火きくすると、ドーミングと「火ぶ くれ」ひすみと、とれらに掘つく位置すれがそれ ぞれ少なくなる。、田率を増加させると強度が増加 する。そとで、マスクのひずみ(反り)を破少さ せることがり能である。さられ、竹が動作しマス クが加熱されるときの各部分の間の幾何学的関係 のせいで、一定のマスクの影優に対して、より大 をい田室を持つマスク上の1点は、より小さい曲 率を持つマスクの、同様の位置にある点に比べて、 スクリンに向けて移動する距離が短い。以上で示 レたマスクの曲率について、ドーミングあるいは マスクの一部分のスクリンに向かつての移動は、 1000 mm の曲率半径を持つマスクでの約48ミクロ ンから、 850 mm の曲率半径を持つマスクで約 30 ミクロンと小さくなる。 * * * の増加によつて、

-316-

₹ B

. 設 B 化、 従来の管と、 従来の管のマスクより大きい 康本 (半径 350 mm 対 1,000 mm) を持つシャドタマスクな 嫌えるとの 発明の管化ついて、 スクリンの中心 部と 周辺郡との中間の 非における 公 先とドーミングによる位置 ずれの 間 炭 熱 果が 示 されている。 とれらの 位は、 ナベて mm 単位である。

はほぼ平代であったと言うととができる。平坦なフェースプレートが好ましいのは、断劇の一部にひずみを停なわないで、より火きい視用を持つととができるからである。第10時に、虚崩状のシャドクマスク74と平而的なフェースプレート76を借える監督観客72が示されている。との管では、適隔 * q * はマスクの中心から間径へ進むに進つて要実上増大し、また、マスク孔の間隔 * a * 6、スクリンよに、竭足すべき鉄光体線パターンを維持できるように同様に増欠されている。

従来の包で行なわれた以上で、マスクの由本を 物かして、マスクを性化し、ドーミングを あかり るという 考え方は、 必ずしも、 球がある。のではない。 第11回に示されるように、 平らなり エースグ レートを持つ陰値原管 80に用いられるマスク78に、マスクを強化する目的で、 逆の動而の曲 あずた せることもできる。 との場合は、マスクの中心から ら間縁へ進むに従って、 関幅。 q * が、 一旦 したのちは少している。そとで、 * a * の の もの 、特別が51-118956 (5)

ドーミングに 公 益・ よみ付着すれ

よる位置すれ 歩 引・

世来の信 .053 .079 -.026 との発明の管 .067 .066 :001

[E]

開稿 " q " の変化に比例して気気され、彼つて、 " a " のほも、マスクの中心部から消録へ進むと ともに、一旦大きくされ、次に小さくされる。

との発明の構成の基本的なおえ方は、シャドク スクの曲気を増大することと、質の中心部から 外へ進むに従つて、簡編"a"を変化させること との組合せれある。在来性のあるものでは、マス クとスクリンの間隔。q*が、マスクの中心部よ り関係で大きくされている。そのような彼に、と の発明を選用する場合には、マスクースクリン問 痛化、より大きい変更が与えられる。しかし、母 禄郎での"q"が中心部での"q"より小さい彼 来の世版造にも、この発明を通用することは可能。 である。そのような管器造に、との発明を消用す る場合には、開稿 * q * が、在来の他の点で同僚 **ま替にかけるより広範囲に変更されることになる。** しかし、とのような発更によつて、現実に、答が、 中心部の " q * より大きい " a * を肩縁部で投つ ことに限られるわけでなく、中心部の"々"より 街かではそるが小さい " q "'を持つ同級部を持つ

[F]

作、あるいは、一部な" q " を持つだも得られよう。 すなわち、この角明は、1 つの管の周辺での" q " が中心での" q " の相対前大きさを閉題とするのではなく、他の点では国議の従来の管での" q " で比べて、中心と同様での" q " の相対的大きさと、その五足とに関係する。また、同じろえ方が、" q " の変化に比例して変化させられるすな" a " についての表現にも超用される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、一部を主軸におつて助闹とした、従来のシャドクマスク製防候報管の平面図、

男名図から第4図までは、根状繁光体数子を持

第10内は、平坝なフェースプレートを持つ路板 兼官の、一部を除いた、平山凶、

第11図は、別の、平坦なフェースプレートを持つ陰極線官の、一部を除いた、平前図である。
- 32・・・スクリン、56、74、78・・・シャドケマスク、 a・・・マスクの礼の中心関係、 q・・・マスクとスクリンとの間の問題。

・ 特許 出 鎖人 アールシーエー コーポレーション 代 暦 人 梢 水 智 低か 2名 ・・特別町51 118956 (6) つスクリンの一郎と、そとに入射する電子ビーム とか示すな大陸

第5図は、シャドクマスクの中心と関係との中 間の位置に生じる電子ピームの位置すれが、時内 の感過とともに変化する状態を示すグラフ、

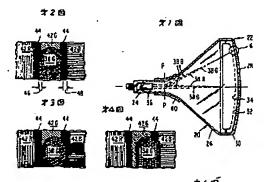
第6 図は、第1 図で符号6で示される部分におけるマスクとスクリンを示す拡大図、

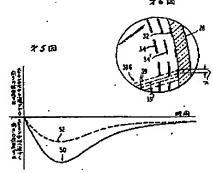
第7回は、電子ピームとマスクとスクリンとの 圏の数何学的関係を示す教図、

第8図は、世来のシャドタマスクを内蔵する管のフェースプレートの、一部を取除いた、背面図、第8 A 図、第8 B B 図、第8 C 図は、マスクの第 8 図に符号で示された位置に対応する部分の拡大

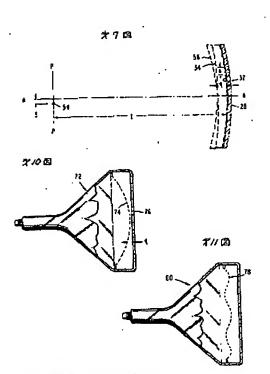
新9 図は、この発明の実施例であるシャドウマネクを持つ路仮設管についての、第8 図と同様の図

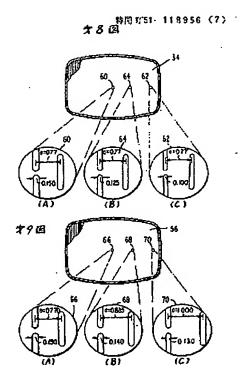
第9 A 23、第9 B 26、第9 C 23 は、第 8 23 の 26 帳条体についての、第 8 A 23、第 8 B 23、第 8 C 対大相当する拡大器。





-318-





特許主機人 アーレ・エ・コーポレーソヨン 代 姓 人 清 小 存 はか2名

| 5. | 添付書類の目録 | |
|----|---------|--|
|----|---------|--|

| (1) | 明 即 录 | <u> </u> |
|------|-------------|----------|
| (\$) | 2 16 | 1.2 |
| (6) | 委任状及びその訳文 | 各1月 |
| (4) | 優先権証明書及びその | 訳文 各1項 |
| (6) | 顧者副本 | 1 # |
| (6) | · 森水院表密商出 | 1 i |
| (7) | F 188 638 | 1 in |

6. 前記以外の代理人

| 伕. | 酢 | 神戸市等企区委共通?丁目4.登地 |
|----|---|------------------|
| | | 神戸斯路会館内 |
| 氏 | 名 | (6299) 田 中 階。 |
| 住 | 酢 | р. |
| 氏 | 8 | (6229) 难 司 正 朔 . |

(B) -3

[A]

The plural electron beam, that was focused, in such a shadow mask cathode ray tube that produces a/the color picture is projected to a mosaic form phosphor screen through the color selection shadow mask that has many slits.

[B]

The geometrical relation of every part of the certain shadow mask cathode ray tube is shown in the 7th figure. Like the 1st figure, line P·P shows the deflection face in a/the zero deflection. The distance between plane P·P and screen 32 are shown as "L" and the distance between shadow mask 34 and screen 32 are shown as "q". Furthermore, "s" shows the distance in deflection face P·P from center 54 of a/the central axis line A·A to electron beam and also "a" shows the center-center intervals of 2 slits of mask 34. The aforementioned measure has the relation as shown in the next formula in a rough estimate. q=L*a/3s

The big change is given by "q", by giving bigger curvature to shadow mask 56 than it is seen with a conventional cathode ray tube, in order to decrease the effect of the doming in this invention. Simultaneously, proportioning to "q" even the value of "a" is changed.

[C]

As shown in the 9th figure, No. 9A figure, No. 9B figure and also No. 9C figure, in shadow mask 56 of the curvature radius of 850 mm that are the embodiment of this invention, the distance "a" between the center of the slit is gradually increasing to the way that are 0.77 mm in central point 66 and are 0.885 mm in intermediate point 68 and are 1000 mm in periphery position 70, respectively.

[D]

The ratio of the distance (q) from mask to screen for 2 type of conventional CRTs and 2 type of CRTs that was produced according to this invention are shown in Table A.

The 1st line shows the ratio of q in the center (of the mask) and q in the edge on the long axis of the mask face. And, the 2nd line shows the same ratio on the diagonal line of the mask face, respectively.

| [Table A] | long axis q/ center q | diagonal line q/ center q |
|---|-----------------------|---------------------------|
| 19 in. 90° deflection conventional CRT | 1.13 | 1.12 |
| 25 in. 110° deflection conventional CRT | 1.10 | 1.09 |
| 25 in. No.1 CRT | 1.47 | 1.45 |
| 25 in. No.2 CRT | 1.58 | 1.48 |

It is understood that the ratio of the periphery q/center q of the CRT in this invention

gets much larger than the same ratio in the conventional CRT.

It is also understood that both of the ratio of the periphery q/center q in the 2 CRTs in this invention are larger than 1.15. When the curvature of the shadow mask is increased from the radius of 1000 mm to the radius of 850 mm, each the doming, the blister strain and the position difference (gap) based on these phenomena decreases.

When the curvature of the mask increases, the strength thereof increases.

[E]

The increase of the common difference in the CRT of this invention depends on the increase of the interval "a", and the decrease of the position difference depends on the increase of the curvature of the shadow mask. Therefore, the position difference in the position where the influence of doming appears most drastically on the screen decreases remarkably by increasing the curvature and the interval "a" of the shadow mask.

Although the shadow mask with regard to the curved shape face plate is described in the aforementioned explanation of which the curvature is increased and the interval "a" is changed, the concept of this invention is also applicable to the flat shape face plate.

[F]

In the 10th figure, cathode ray tube 72 is shown with curved surface shadow mask 74 and flat shape face plate 76. In this cathode ray tube, the interval "q" virtually increases as it goes from center to periphery of the shadow mask, and also the interval "a" of the mask slit similarly increases in order to maintain the sufficient phosphor line pattern on the screen.

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| u | BLACK BORDERS |
|---|---|
| 7 | IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| 4 | FADED TEXT OR DRAWING |
| Ø | BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| | SKEWED/SLANTED IMAGES |
| | COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| | GRAY SCALE DOCUMENTS |
| | LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| | REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| | OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox